

MNOIC-UMEMSME セミナー

日時：12月7日（水）15時00分から17時00分

第一部 15時00分から15時30分（無料）

第二部 15時30分から16時00分（無料）

第三部 16時00分から17時00分（参加費：資料代5,000円）

場所：産業技術総合研究所東事業所 NMEMS イノベーション棟 1F 国際セミナー室
（〒305-8564 茨城県つくば市並木 1-2-1 TEL: 029-886-3471 FAX: 029-886-3472）
<http://mnoic.la.coocan.jp/access/index.html>

第一部

15:00-15:30 表面処理技術（表面改質・精密洗浄）及び表面処理剤の開発

講師：株式会社ネオス 衛藤 善美 氏

※尚、こちらは無料でご参加頂けます。

第二部

15:30-16:00 ガラス熱インプリントを目的とした電鍍金型の開発

講師：神奈川県産業技術センター 電子技術部 電子材料チーム 主任研究員 安井 学 氏

概要：次世代の微細加工技術として、熱インプリント技術が注目されているが、加工材料は有機材料やゾルゲル材料など成型しやすい材料に限られている。その主な原因はガラス熱インプリント用金型の開発が遅れているためである。今回は、ガラス熱インプリントを目的とした電鍍金型の開発についてのご報告を致します。

※尚、こちらは無料でご参加頂けます。

第三部

16:00-17:00 「第4回 MOT セミナー：製品開発マネジメント（3）開発事例」

講師：一般財団法人マイクロマシンセンター

マイクロナノ・オープン・イノベーションセンター（MNOIC）主任研究員 原田 武 氏

概要：MEMS の開発事例 — 光スイッチ、及びMEMS 用設計解析ツール「MemsONE」のご紹介。

※参加費（資料代）：5,000円（UMEMSME 関連研究員及び、MNOIC ユーザは無料）

ご参加ご希望の方は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MNOIC-UMEMSME セミナー「第4回 MOT セミナー：製品開発マネジメント（3）開発事例」

ご参加ご希望

- ・ 貴法人名 :
- ・ 貴所属 :
- ・ ご芳名 :
- ・ e-mail アドレス :
- ・ 電話番号 :
- ・ 参加費（資料代）：5,000円（当日受付にて徴収をさせていただきます。）
- ・ 無料セミナー：「第一部・第二部」のみ参加希望します。（Yes, No）
Yes の場合は参加費を消去してください。

上記をご記入頂き、MNOIC-UMEMSME セミナー担当者

一般財団法人マイクロマシンセンター MNOIC 開発センター（つくば）水谷
（E-mail：e_mizutani@mmc.or.jp）までメールにてご返信下さいませ。

また、当日のご参加も受付を致しておりますので、是非ご参加下さいませ。
皆様方のご参加をお待ち致しております。

マイクロナノオープンイノベーションセンター（MNOIC）は TIA（つくばイノベーションアリーナ）の NMEMS 研究設備を含む研究プラットフォームを産業界が利活用する様々なサービスを提供します。詳しくは

E-mail: mnoic@mmc.or.jp

URL: <http://mnoic.la.coocan.jp/>